

掺 Sb 的 ZnO 单晶的缺陷和性质研究^{*}

张 瑞 张 璞 赵有文[†] 董志远 杨 俊

(中国科学院半导体研究所, 北京 100083)

摘要: 采用化学气相传输法生长了掺 Sb 的 ZnO 体单晶, 生长温度为 950°C。与非掺 ZnO 单晶相比, 掺 Sb 后 ZnO 单晶仍为 n 型, 其自由电子浓度明显升高。X 射线光电子能谱(XPS)测量结果表明, 掺入的 Sb 在 ZnO 单晶中可能占据了 Zn 位, 或处于间隙位置, 形成了施主。利用光致发光谱(PL)测量发现掺 Sb 后 ZnO 单晶发出蓝光, 该蓝色荧光与浅施主有关。这些结果表明在高温生长条件下, 掺 Sb 后 ZnO 单晶中产生了高浓度的施主缺陷, 因而难以获得 p 型材料。

关键词: ZnO; 单晶; 掺杂; 缺陷

PACC: 611OC; 8160; 7120

中图分类号: TN304. 2⁺ 1

文献标识码: A

文章编号: 0253-4177(2008)10-1988-04

1 引言

ZnO 为 II-VI 族直接宽带隙半导体材料, 室温下带宽 3.37eV, 并具有 60meV 的高激子束缚能, 使其在短波长光电器件领域具有很大的应用潜力^[1]。由于原生 ZnO 中存在本征施主缺陷, 如 V_O, Zn_i 等, 导致 ZnO 呈 n 型导电性。使用 III 族元素, 如 Al, Ga, In 等较容易实现 ZnO 的 n 型掺杂^[2,3]。然而, 受到自身施主缺陷多、自补偿作用以及受主杂质固溶度低等因素的影响, p 型 ZnO 材料难以制备^[4,5]。目前多采用 V 族元素如 N, P, As, Sb^[6~20]等作为掺杂剂, 利用各种薄膜生长方法制备 p 型 ZnO, 但是重复性和可靠性不高。这个问题已成为研制 ZnO 发光器件的一大障碍。通常在低温下生长的 V 族元素掺杂的 ZnO 薄膜显示出 p 型导电性^[14,18~20], 但在高温下生长或退火后的 ZnO 薄膜为 n 型材料。为此, 有必要研究 V 族元素掺杂 ZnO 的缺陷和补偿机制, 以便解决 ZnO 单晶的 p 型掺杂问题。有关高温条件下生长的 V 族元素掺杂 ZnO 单晶的缺陷研究结果为数不多, 而 V 族元素掺杂 ZnO 体单晶的研究更是鲜见报道。因此, 本文利用闭管化学气相传输法(CVT)生长了 Sb 元素掺杂的 ZnO 体单晶, 对其电学和光学性质进行了测试, 分析了 Sb 掺杂 ZnO 单晶施主缺陷形成的机理和缺陷属性。

2 实验

实验中使用的 ZnO 单晶由闭管 CVT 法生长, 具体的生长过程见参考文献[21,22]。高纯 Sb(纯度为 6N)按一定比例与 ZnO 粉料一起放置在源区。源区的温度为 1000°C, 生长区的温度为 950°C。源区的固态 Sb 在高温下转变为气态后与 ZnO 组分气体一起通过扩散和对

流传输至生长区实现 ZnO 单晶的生长和 Sb 掺杂。生长 ZnO 单晶时所用的籽晶为 10mm × 10mm, (0001) 晶向的非掺 ZnO 单晶片。对生长出的 ZnO 单晶进行切割、研磨和抛光后, 制备成厚度为 0.5mm 的(0001)晶片样品, 供测试分析使用。我们还对原生掺 Sb 的 ZnO 单晶进行了 850°C, O₂ 气氛下的退火处理, 以便进行比较和分析。

ZnO 单晶的电学性质由常规 Hall 效应测量表征。ZnO 单晶的杂质及其化学状态由 XPS 测量分析, 使用 PL 谱分析了 ZnO 单晶的发光特性和相关的缺陷。利用 Raman 散射比较了非掺和掺 Sb 的 ZnO 单晶的完整性和缺陷。

3 结果与讨论

表 1 给出了原生非掺、原生及退火后掺 Sb 的 ZnO 单晶样品的典型霍尔测试结果。可以看出, Sb 掺杂后 ZnO 单晶样品仍呈现 n 型导电特性, 但与非掺样品相比, 其载流子浓度明显升高, 电阻率下降。这表明掺 Sb 后 ZnO 单晶中形成了施主缺陷, 而没有形成受主。经 850°C, O₂ 气氛下退火后, 掺 Sb 的 ZnO 单晶的载流子浓度有所降低, 电阻率升高, 这可以归结为在富氧条件下, 退火过程消除了部分点缺陷(V_O, Zn_i 等), 降低了施主浓度。下面的测试分析结果给出进一步的证明。

图 1 为原生及 O₂ 气氛下退火后掺 Sb 的 ZnO 单晶

表 1 非掺 ZnO 单晶及掺 Sb 的 ZnO 单晶的室温电学参数
Table 1 Room temperature electrical properties of undoped and Sb doped ZnO single crystal

样品	生长温度 /°C	载流子浓度 /cm ⁻³	电阻率 /(Ω · cm)	迁移率 /(cm ² /(V · s))
非掺 ZnO	950	2.821 × 10 ¹⁷	1.223 × 10 ⁻¹	182
ZnO : Sb	950	9.582 × 10 ¹⁷	7.771 × 10 ⁻²	87
退火 ZnO : Sb	850	5.374 × 10 ¹⁷	9.565 × 10 ⁻²	122

* 国家自然科学基金资助项目(批准号: 60736032)

† 通信作者。Email: zhaoyw@red.semi.ac.cn

2008-03-26 收到, 2008-04-24 定稿

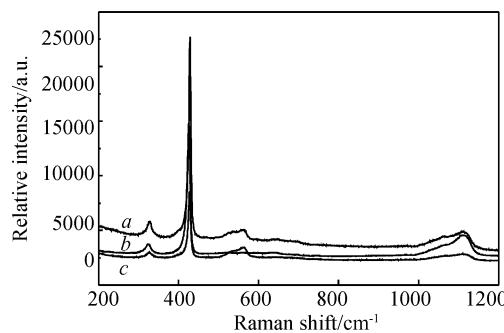


图1 喇曼散射谱 曲线a:掺Sb的ZnO;曲线b:退火后的掺Sb的ZnO;曲线c:原生非掺的ZnO

Fig.1 Raman scattering spectra Curve a: Sb-doped ZnO before annealing; Curve b: Sb-doped ZnO after annealing; Curve c: Undoped ZnO

以及一个非掺ZnO单晶的喇曼光谱图。从图中可以看到这些ZnO晶体有4个声子散射模式:332cm⁻¹,437cm⁻¹,578cm⁻¹和1159cm⁻¹,其中主要的437cm⁻¹以及1159cm⁻¹峰对应于ZnO单晶光声子E2,E3模式;而332cm⁻¹峰对应于166cm⁻¹低频E2模的2倍散射频率。在这些散射峰当中,大量的研究报道通常认为578cm⁻¹处的峰是由缺陷引起的^[23~25]。结合生长条件的变化、电子辐照和退火处理等实验研究结果,578cm⁻¹被证明与V_O有关^[26~29]。因而图1的结果表明原生非掺和掺Sb的ZnO单晶中存在V_O缺陷,而经过退火处理后掺Sb的ZnO单晶的578cm⁻¹散射峰消失,表明退火消除了单晶中的V_O。

图2(a)为Sb掺杂ZnO单晶的XPS图谱。从插图可以看到测试得到的Sb3d_{5/2}谱峰,并且在图2(a)的全谱中可以看到中心在943eV处的Sb3s谱峰,对比非掺ZnO的XPS图谱(c),证实了晶体中Sb的存在。图2(a)中Sb的束缚能约为530.8eV,与Sb—O键有关^[30]。由此可以推断掺入的Sb没有占据O位,而极可能代替Zn位;或处于间隙的位置,形成施主。以前的研究表明^[31],由于CVT生长条件为富Zn^[21],容易导致在ZnO单晶中产生V_O和Zn_i缺陷,而使Zn和O偏离平衡计量比。经过高温O₂气氛下退火后,预计可降低这些缺陷的浓度。比较图2(a)和(b)插图,可以看到退火后ZnO单晶的Sb3d_{5/2}和O1s峰形更为对称,表明晶体质量提高。另外,退火后氧的补充,消除了一些深施主能级,并使得Zn,O更接近平衡化学计量比。

图3给出了原生及退火处理后掺Sb的ZnO单晶的XRD图谱。从图中可以看到尖锐的ZnO(002)衍射峰,说明Sb掺杂后ZnO单晶仍保持c轴取向。另外,图中并没有明显的第二相对应的衍射峰出现,退火后衍射峰的半高宽减小,表明晶体质量有所改善。从图3还可以看出退火后掺Sb的ZnO单晶的(002)衍射角变小,由此可以推测其c轴晶格常数变大,意味着退火消除V_O后,减少了晶格的收缩。

我们用He-Cd激光器(波长325nm)做激发光源,对非掺和掺Sb的ZnO单晶的光致发光进行了测量。图4给出的是室温PL谱,除带边紫外发光峰外,可以明显

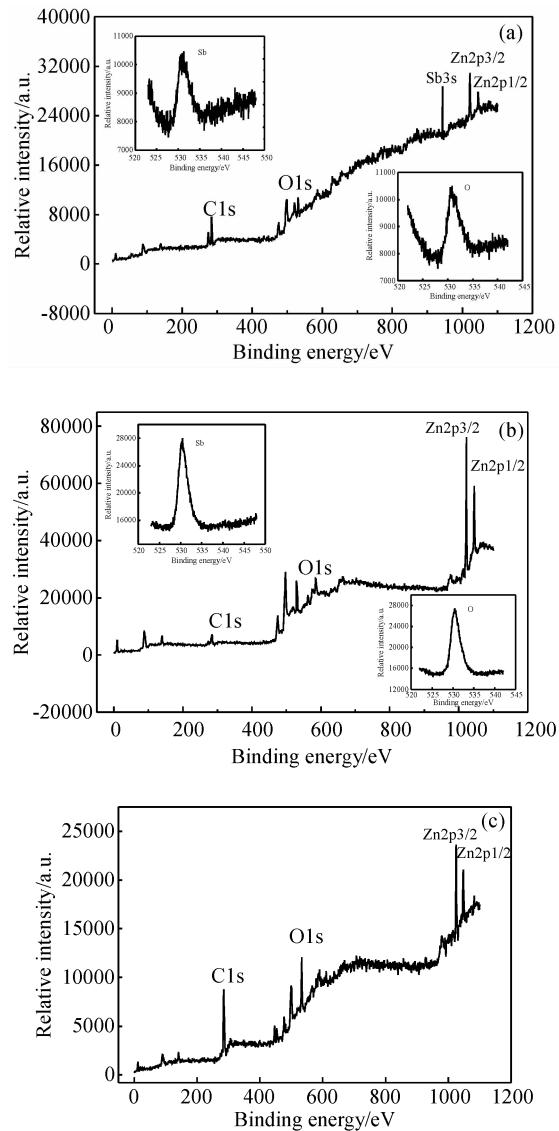


图2 XPS谱(插图为退火前后Sb3d_{5/2}以及O1s的XPS谱) (a)退火前掺Sb的ZnO晶体;(b)退火后掺Sb的ZnO晶体;(c)同样条件下生长的非掺ZnO

Fig.2 XPS spectra (The insets are XPS spectra of Sb3d_{5/2} and O1s before and after annealing, respectively) (a) Sb-doped ZnO before annealing; (b) Sb-doped ZnO after annealing; (c) Undoped ZnO grown under same condition

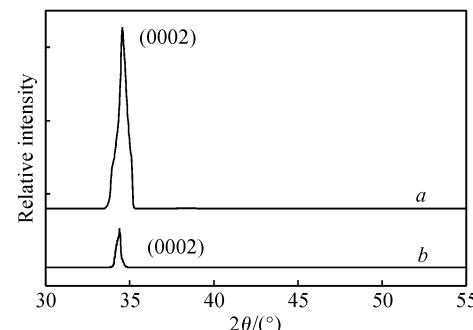


图3 XRD图谱 曲线a:退火前掺Sb的ZnO;曲线b:退火后掺Sb的ZnO

Fig.3 XRD spectra Curve a: Sb-doped ZnO before annealing; Curve b: Sb-doped ZnO after annealing

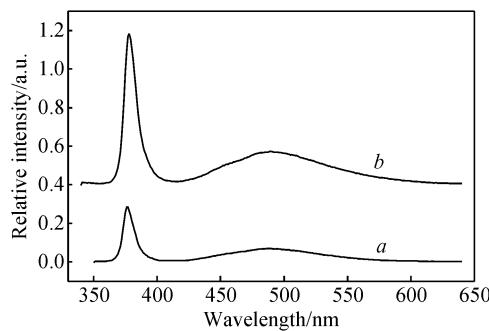


图 4 室温光致发光谱 曲线 a:非掺 ZnO;曲线 b:掺 Sb 的 ZnO
Fig. 4 RT PL spectra Curve a : Undoped ZnO; Curve b : Sb-doped ZnO

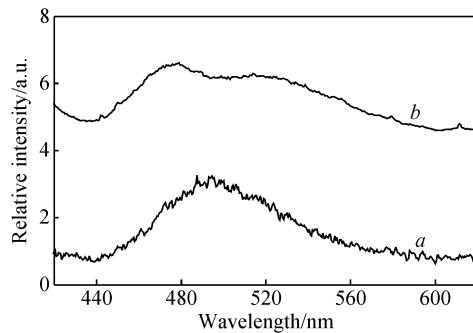


图 5 低温光致发光谱 曲线 a:非掺 ZnO;曲线 b:掺 Sb 的 ZnO 单晶样品
Fig. 5 6K PL spectra Curve a : Undoped ZnO; Curve b : Sb-doped ZnO

看到一个很宽的发光峰,中心位于 489 nm,是 ZnO 单晶中众所周知的绿峰带,其发光机理通常认为与 V_O 等多个缺陷有关^[32]. 据此可以认为这些 ZnO 单晶中存在 V_O 等缺陷,这与前面的分析一致.

为了进一步分析掺 Sb 的 ZnO 单晶中的缺陷,我们进行了 6K 温度下的 PL 测试,结果如图 5 所示,图中选取了放大后 400~500 nm 处的谱线. 在掺 Sb 的 ZnO 样品对比非掺样品的 PL 谱明显有两个峰. 其中中心大约在 477 nm 处的蓝色荧光峰,对应于 2.6 eV 的电子迁移能量,一般认为是从 Zn_i 缺陷能级到 V_{Zn} 缺陷能级的电子跃迁^[33,34],而峰值在 520 nm 处的宽峰与绿峰带有关. 这些结果表明,掺 Sb 的 ZnO 单晶中存在 V_O 和 Zn_i 缺陷.

上述结果表明,CVT 法生长的 ZnO 单晶中掺入 V 族元素 Sb 后,一方面 Sb 可能占据了 Zn 位,或处于填隙位置,形成了施主,另一方面还产生 V_O 和 Zn_i 缺陷. 这些施主缺陷导致了掺 Sb 后获得的 ZnO 单晶仍为 n 型,难以获得 p 型材料. 因此,控制 ZnO 单晶生长条件,抑制施主缺陷的产生,使 Sb 占据 O 位形成受主是获得 p 型 ZnO 单晶的关键,这也是我们今后进一步研究的重点.

4 结论

在常规 CVT 法生长的掺 Sb 的 ZnO 单晶中,Sb 可

能占据 Zn 位,或处于填隙位置,同时产生了 V_O 和 Zn_i 缺陷. 这些缺陷起施主作用,使掺 Sb 的 ZnO 单晶呈 n 型导电特性. 经过高退火后, V_O 缺陷被有效消除,晶体质量得到一定改善. 通过控制生长条件抑制施主缺陷的产生是获得 p 型 ZnO 单晶的关键途径.

参考文献

- [1] Zu P,Tang Z K,Wong G K L,et al.Ultraviolet spontaneous and stimulated emissions from ZnO microcrystallite thin films at room temperature. Solid State Commun.,1997,103(8):459
- [2] Kim K K,Niki S,Oh J Y,et al.High electron concentration and mobility in Al-doped n-ZnO epilayer achieved via dopant activation using rapid-thermal annealing.J Appl Phys,2005,97:066103
- [3] Makino T,Segawa Y,Yoshida S,et al.Gallium concentration dependence of room-temperature near-band-edge luminescence in n-type ZnO : Ga. Appl Phys Lett,2004,85:759
- [4] Walukiewicz W.Defect formation and diffusion in heavily doped semiconductors.Phys Rev B,1994,50(8):5221
- [5] Van de Walle C G,Laks D B,Neumark G F,et al.First-principles calculations of solubilities and doping limits: Li, Na, and N in ZnSe. Phys Rev B,1993,47(15):9425
- [6] Look D C,Reynolds D C,Litton C W,et al.Characterization of homoepitaxial p-type ZnO grown by molecular beam epitaxy. Appl Phys Lett,2002,81(10):1830
- [7] Bian J M,Li X M,Zhang C Y,et al.P-type ZnO films by monodoping of nitrogen and ZnO-based p-n homojunctions. Appl Phys Lett,2004,85:4070
- [8] Liang H W,Lu Y M,Shen D Z,et al.P-type ZnO thin films prepared by plasma molecular beam epitaxy using radical NO. Phys Status Solidi A,2005,202(6):1060
- [9] Cao P,Zhao D X,Zhang J Y,et al.Optical and electrical properties of p-type ZnO fabricated by NH₃ plasma post-treated ZnO thin films. Appl Surf Sci,2008,254:2900
- [10] Kim K K,Kim H S,Hwang D K,et al.Realization of p-type ZnO thin films via phosphorus doping and thermal activation of the dopant. Appl Phys Lett,2003,83(1):63
- [11] Vaithianathan V,Lee B T,Kim S S.Growth of phosphorus doped ZnO thin films by pulsed laser deposition. Phys Status Solidi A,2004,201(12):2837
- [12] Hwang D K,Kim H S,Lim J H.Study of the photoluminescence of phosphorus-doped p-type ZnO thin films grown by radio-frequency magnetron sputtering. Appl Phys Lett,2005,86:151917
- [13] Kwon B J,Kwack H S,Lee S K,et al.Optical investigation of p-type ZnO epilayers doped with different phosphorus concentrations by radio-frequency magnetron sputtering. Appl Phys Lett,2007,91:061903
- [14] Allenic A,Guo W,Chen Y B,et al.Amphoteric phosphorus doping for stable p-type ZnO. Adv Mater,2007,19:3333
- [15] Ryu Y R,Lee T S,White H W.Properties of arsenic-doped p-type ZnO grown by hybrid beam deposition. Appl Phys Lett,2003,83(1):87
- [16] Look D C,Renlund G M,Burgener R H II,et al.As-doped p-type ZnO produced by an evaporation/sputtering process. Appl Phys Lett,2004,85(22):5269
- [17] Vaithianathan V,Lee B T,Kim S S.Preparation of As-doped p-type ZnO films using a Zn₃As₂/ZnO target with pulsed laser deposition. Appl Phys Lett,2005,86:062101
- [18] Xiu F X,Yang Z,Mandalapu L J,et al.Photoluminescence study of Sb-doped p-type ZnO films by molecular-beam epitaxy. Appl Phys Lett,2005,87:252102
- [19] Xiu F X,Yang Z,Mandalapu L J,et al.High-mobility Sb-doped p-type ZnO by molecular-beam epitaxy. Appl Phys Lett,2005,87:152101

- [20] Pan X H, Ye Z Z, Li J S, et al. Fabrication of Sb-doped p-type ZnO thin films by pulsed laser deposition. *Appl Surf Sci*, 2007, 253:5067
- [21] Zhao Y W, Dong Z Y, Wei X C, et al. Growth of ZnO single crystal by chemical vapor transport method. *Chinese Journal of Semiconductors*, 2006, 27(2):336(in Chinese) [赵有文, 董志远, 魏学成, 等. 化学气相传输法生长 ZnO 单晶. 半导体学报, 2006, 27(2):336]
- [22] Wei X C, Zhao Y W, Dong Z Y, et al. Control of vapor transport process of large size ZnO single crystal growth. *Chinese Journal of Semiconductors*, 2007, 28(6):869(in Chinese) [魏学成, 赵有文, 董志远, 等. 气相运法大尺寸 ZnO 单晶生长的传输过程控制. 半导体学报, 2007, 28(6):869]
- [23] Tzolov M, Tzenov N, Dimova-Malinovska D, et al. Vibrational properties and structure of undoped and Al-doped ZnO films deposited by RF magnetron sputtering. *Thin Solid Films*, 2000, 379: 28
- [24] Zeng J N, Low J K, Ren Z M, et al. Effect of deposition conditions on optical and electrical properties of ZnO films prepared by pulsed laser deposition. *Appl Surf Sci*, 2002, 197:362
- [25] Youn C J, Jeong T S, Han M S, et al. Optical properties of Zn-terminated ZnO bulk. *J Cryst Growth*, 2004, 261:526
- [26] Chen Z Q, Maekawa M, Kawasuso A. Electron irradiation-induced defects in ZnO studied by positron annihilation. *Physica B*, 2006, 376:722
- [27] Exarhos G J, Sharma S K. Influence of processing variables on the structure and properties of ZnO films. *Thin Solid Films*, 1995, 270 (1/2) :27
- [28] Xing Y J, Xi Z H, Xue Z Q, et al. Optical properties of the ZnO nanotubes synthesized via vapor phase growth. *Appl Phys Lett*, 2003, 83(9):1689
- [29] Rajalakshmi M, Arora A K, Bendre B S, et al. Optical phonon confinement in zinc oxide nanoparticles. *J Appl Phys*, 2000, 87 (5):2445
- [30] NIST X-ray photoelectron spectroscopy database. <http://srdata.nist.gov/xps/>
- [31] Wei X C, Zhao Y W, Dong Z Y, et al. Investigation of native defects and property of bulk ZnO single crystal grown by a closed chemical vapor transport method. *J Cryst Growth*, 2008, 310:639
- [32] Meyer B K, Sann J, Hofmann D M, et al. Shallow donors and acceptors in ZnO. *Semicond Sci Technol*, 2005, 20:S62
- [33] Sun Y M. A study on the electronic structure of ZnO and its several defects. PhD Thesis, University of Science and Technology of China, 2000 (in Chinese) [孙玉明. ZnO 及其缺陷电子结构的 FP-LMTO 研究. 中国科学技术大学博士学位论文, 2000]
- [34] Wei X Q, Man B Y, Xue C S, et al. Blue luminescent center and ultraviolet-emission dependence of ZnO films prepared by pulsed laser deposition. *Jpn J Appl Phys*, 2006, 45(11):8586

Defects and Properties of Antimony-Doped ZnO Single Crystal *

Zhang Rui, Zhang Fan, Zhao Youwen[†], Dong Zhiyuan, and Yang Jun

(Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China)

Abstract: Sb-doped ZnO single crystal has been grown at 950°C by the chemical vapor transport method. Compared to undoped ZnO, the Sb-doped ZnO single crystal is still n-type with an apparent increase of free electron concentration. X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) measurement results suggest a possible occupation of the Zn site of the doped Sb in the ZnO single crystal, resulting in the formation of a donor. Blue emission is observed from the PL spectrum of the Sb doped ZnO single crystal, which is related with a shallow donor defect in ZnO. The results indicate that a high concentration of donor defects forms in ZnO after Sb doping at high temperature, making it difficult to obtain p-type material.

Key words: ZnO; single crystal; doping; defect

PACC: 6110C; 8160; 7120

Article ID: 0253-4177(2008)10-1988-04

* Project supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 60736032)

† Corresponding author. Email: zhaoyw@red.semi.ac.cn

Received 26 March 2008, revised manuscript received 24 April 2008

©2008 Chinese Institute of Electronics